

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成25年3月7日(2013.3.7)

【公開番号】特開2010-150579(P2010-150579A)

【公開日】平成22年7月8日(2010.7.8)

【年通号数】公開・登録公報2010-027

【出願番号】特願2008-327696(P2008-327696)

【国際特許分類】

C 23C 14/34 (2006.01)

【F I】

C 23C 14/34 C

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ターゲットが取り付けられる回転自在な回転部材と、

前記ターゲットと電気的に接続され、前記回転部材の回転軸に沿った方向の前記回転部材の端部に配置された接続端子と、

回転軸方向に往復移動可能に構成され、前記接続端子を介して前記ターゲットに電力を供給する給電端子と、を有し、

前記給電端子を前記往復移動させることにより、前記給電端子を前記接続端子と接触または離間させ、前記給電端子と前記接続端子との導通または絶縁を切り替え可能なことを特徴とするスパッタリング装置。

【請求項2】

前記給電端子と前記接続端子との少なくとも一方が、前記回転部材の回転方向に沿って延びている、請求項1に記載のスパッタリング装置。

【請求項3】

前記回転部材は前記ターゲットを複数取り付け可能に構成されており、

前記回転部材の前記端部には、前記ターゲットのそれぞれと接続される前記接続端子が配置されており、

それぞれの前記接続端子は、前記回転部材の回転方向に並べられている、請求項1又は2に記載のスパッタリング装置。

【請求項4】

前記回転部材の回転にともなって、前記給電端子と接続される前記接続端子が切り替わる、請求項1から3のいずれか1項に記載のスパッタリング装置。

【請求項5】

前記回転部材に取り付けられている前記ターゲットの表面に磁束を発生させるマグネットが、前記回転部材の内部に配されている、請求項1から4のいずれか1項に記載のスパッタリング装置。

【請求項6】

前記回転部材が少なくとも2つ設置されている、請求項1から5のいずれか1項に記載のスパッタリング装置。

【請求項7】

前記回転部材の、前記ターゲットが取り付けられる面に対向して配置され、処理を行う基体を保持するホルダーをさらに備える、請求項1から6のいずれか1項に記載のスパッタリング装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

上記課題の少なくとも1つを解決するため、本発明に係るスパッタリング装置は、ターゲットが取り付けられる回転自在な回転部材と、前記ターゲットと電気的に接続され、前記回転部材の回転軸に沿った方向の前記回転部材の端部に配置された接続端子と、回転軸方向に往復移動可能に構成され、前記接続端子を介して前記ターゲットに電力を供給する給電端子と、を有し、前記給電端子を前記往復移動させることにより、前記給電端子を前記接続端子と接触または離間させ、前記給電端子と前記接続端子との導通または絶縁を切り替え可能に構成される。